

# 「ナノファブスクエア」開催案内

新川崎・創造のもりのNANOBIICオープンラボ  
ナノ・マイクロ技術講習・実習会

回	プロセス	実習で利用する装置(材料)	日程
1	超解像度レーザー顕微鏡	超解像度レーザー顕微鏡	3/9(木)
2	フォトマスク作製	レーザー描画装置	5/12(金)
3	レジスト塗布	コータデベロッパ装置、スピコート	6/9(金)
4	精密リソグラフィ	両面マスクアライナ	6/23(金)
5	加工表面観察	超高解像度表面形状計測装置、触針式段差計	8/24(木)
6	シリコンドライエッチング	シリコン深堀りDRIE装置	9/14(木)
7	ガラスエッチング	高密度プラズマドライエッチング装置	以降原則毎月 第2第4の 木曜または金曜 にて実施
8	マイクロモールドング	両面マスクアライナ、ベーク炉(PDMS)	
9	金属薄膜形成(1)	4元マグネトロンサイドスパッタ	
10	金属薄膜形成(2)	ECR スパッタ	
11	パリレン薄膜形成	パリレン蒸着装置	
12	ウェーハ切断	ダイサ	
13	デバイス接合	プラズマ発生装置	
14	ウェットエッチング		
15	3次元加工構造観察	レーザー顕微鏡、3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	
16	超解像度蛍光観察	超解像度レーザー顕微鏡	

## 場所

かわさき新産業創造センター (KBIC)新館 NANOBIIC  
川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり (JR新川崎駅から徒歩10分)

## 実習概要

マイクロ流路の一連の試作を、シリコン、ガラス、樹脂を使い実施し、表面形態の観察・評価までを行うプログラムにより、目的に応じた受講が可能です

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム  
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市

共催：(一社)日本機械学会(予定)、次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

定員：5名程度(先着) 参加費：原則実費(個別チラシに費用を掲載)を負担いただきます。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、産学連携による技術や産業の創出に寄与するため、川崎市、KISTECと連携し、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の開放利用を行っています。今後、4大学の機器を更に効果的にご利用いただくため、企業や大学の方を対象としたナノ・マイクロ技術講習・実習会『ナノファブスクエア』の個別チラシを順次掲載し開催して参りますのでご参加ください(NANOBIICオープンラボホームページ <http://open-labo.skr.jp/>)。

「NANOBIICオープンラボ」  
ホームページに随時掲載、  
開放利用機器の詳細仕様は  
機器一覧をご覧ください。



問合せ窓口：唐澤志郎 Tel：080-6560-3061 / E-mail：karasawa@newkast.or.jp  
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所  
※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金をご利用できます  
(URL：<http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000085717.html>)にてご相談ください。